八四六二・一一	密閉型鍛造機	無税
八四六二・一九	その他のもの ベンディングマシン、フォールディングマシン、ストレートニングマシン及びフラットニングマシン（プレスブレーキを含む。）（圧延製品用のものに限る。）	無税
八四六二・二二	形状成形機	無税
八四六二・二三	数値制御式のプレスブレーキ	無税
八四六二・二四	数値制御式のパネルベンダー	無税
八四六二・二五	数値制御式のロール成形機	無税
八四六二・二六	その他の数値制御式のベンディングマシン、フォールディングマシン、ストレートニングマシン及びフラットニングマシン	無税
八四六二・二九	その他のもの スリッター機、切断機及びその他の剪断機（パンチングマシン及びニブリングマシンを除く。）（圧延製品用のものに限る。）	無税
八四六二・三二	スリッター機及び切断機	無税
八四六二・三三	数値制御式の剪断機	無税
八四六二・三九	その他のもの パンチングマシン、ノッチングマシン及びニブリングマシン（プレスを除くものとし、パンチング機能及び剪断機能を組み合わせた機械を含む。）（圧延製品用のものに限る。）	無税
八四六二・四二	数値制御式のもの	無税
八四六二・四九	その他のもの 別表第八四七九・二〇号中「動物性又は植物性の油脂」を「動物性油脂、植物性油脂又は微生物性油脂」に改め、同表第八四七九・八二号の次に次の一号を加える。	無税
八四六二・五一	炉心管、管、中空断面材及び棒用の機械（プレスを除く。）	無税
八四六二・五九	数値制御式のもの	無税
	その他のもの 別表第八四八二・四〇号中「針状ころ軸受」の下に「（保持器と針状ころを組み合わせたものを含む。）」を加える。	無税
八四六二・六一	冷間金属加工プレス 液圧プレス	無税
八四六二・六二	機械プレス	無税
八四六二・六三	サーボプレス	無税
八四六二・六九	その他のもの	無税
八四六二・九〇	その他のもの 別表第八四八二・四〇号中「針状ころ軸受」の下に「（保持器と針状ころを組み合わせたものを含む。）」を加える。 別表第八四・八四項の次に次の一項を加える。	無税
八四七九・八三	冷間静水圧プレス 別表第八四八二・四〇号中「針状ころ軸受」の下に「（保持器と針状ころを組み合わせたものを含む。）」を加える。	無税
八四・八五	積層造形用の機械	
八四八五・一〇	メタルデポジット方式によるもの	無税
八四八五・二〇	プラスチックデポジット方式又はラバーデポジット方式によるもの	無税
八四八五・三〇	プラスターデポジット方式、セメントデポジット方式、セラミックデポジット方式又はガラスデポジット方式によるもの	無税
八四八五・八〇	その他のもの	無税
八四八五・九〇	部分品 別表第八四・八六項中「注９(C)」を「注11(C)」に改める。 別表第八五類の注中10を削り、９(a)を次のように改める。 (a)(i)　「半導体デバイス」とは、その働きが電界の作用又は半導体ベースの変換器に基づく抵抗率の変動により行われる半導体デバイスをいう。 半導体デバイスには、複数の素子を組み合わせたもの（能動デバイス又は受動デバイスの補助機能を備えているかいないかを問わない。）を含む。 この定義において、「半導体ベースの変換器」とは、物理現象若しくは化学現象若しくは動作を電気的信号に変換し又は電気的信号を物理現象若しくは動作に変換することができるといった固有の機能を果たす半導体ベースセンサー、半導体ベースアクチュエーター、半導体ベースレゾネーター及び半導体ベースオシレーター（個別の半導体ベースのデバイス）をいう。 半導体ベースの変換器の全ての素子は、不可分の状態に結合されており、それらの構造又は機能を果たすために必要な素材を不可分の状態に取り付けたものを含む。 次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。 (1)　「半導体ベース」とは、半導体基板上に形成若しくは製造されたもの又は半導体素材によつて作られたもので、半導体技術により製造されたものをいう（半導体基板又は素材が決定的かつ代替不可能な変換器としての機能を果たすもので、かつ、その働きが物理的、電気的、化学的及び光学的特性を含む半導体の特性に基づくものに限る。）。 (2)　「物理現象又は化学現象」とは、圧力、音波、加速度、振動、移動、方向、歪み、磁界強度、電界強度、光、放射能、湿度、フロー、化学物質濃度等の現象に関連するものをいう。 (3)　「半導体ベースセンサー」とは、半導体の内部又は表面に生成させたマイクロ電子構造体又は機械構造体から成り、電気特性の変化又は機械構造体の変位によつて生ずる物理量又は化学量を検出し、これらを電気信号に変換する機能を有するものをいう。 (4)　「半導体ベースアクチュエーター」とは、半導体の内部又は表面に生成させたマイクロ電子構造体又は機械構造体から成り、電気信号を物理的な動きに変換する機能を有するものをいう。 (5)　「半導体ベースレゾネーター」とは、半導体の内部又は表面に生成させたマイクロ電子構造体又は機械構造体から成り、外部入力に応じて、これらの構造体の物理的形状に依存するあらかじめ設定した周波数の機械的又は電気的な振動を発生する機能を有する半導体デバイスをいう。 (6)　「半導体ベースオシレーター」とは、半導体の内部又は表面に生成させたマイクロ電子構造体又は機械構造体から成り、これらの構造体の物理的形状に依存するあらかじめ設定した周波数の機械的又は電気的な振動を発生する機能を有する半導体デバイスをいう。 (ii)　「発光ダイオード（ＬＥＤ）」とは、電気エネルギーを可視光線、赤外線又は紫外線に変換する半導体素材をもとにした半導体デバイス（互いに電気的に結合しているかいないか又は保護ダイオードと接続しているかいないかを問わない。）をいう。第八五・四一項の発光ダイオード（ＬＥＤ）は、電源供給又は電源制御用の素子を自蔵していない。 別表第八五類の注９(b)(iv)３(a)中「は、」を「とは、」に、「物理量又は化学量」を「物理現象又は化学現象」に、「である」を「をいう」に改め、「実世界の」を削り、「関連する」の下に「ものをいう」を加え、同注９中「注９」を「注12」に改め、同注中９を12とし、８を10とし、その次に次のように加える。	無税